

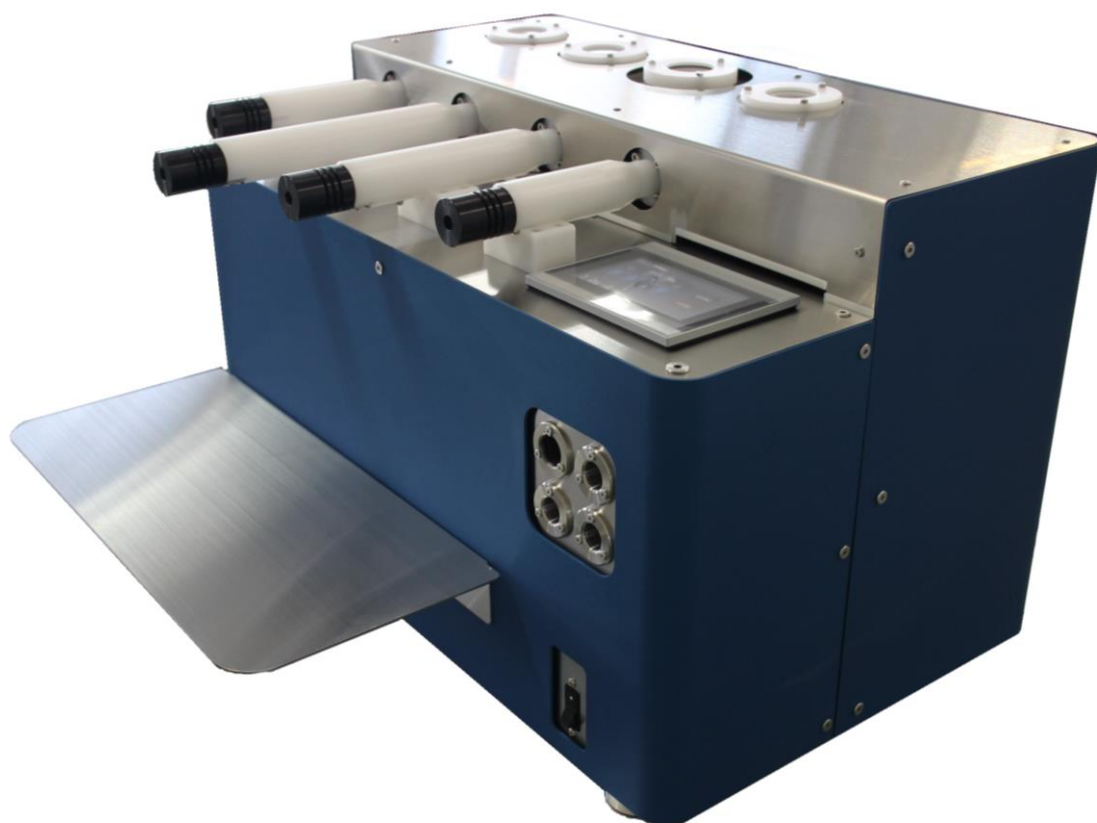


FEH-02 形

# TEM ホルダー保管装置

4本独立の排気操作が可能な真空保管装置

- 本装置は TEM ホルダーをオイルフリー真空下で保管する装置です。
- 本装置を使用することにより、コンタミネーションの付着を大幅に減らすことが可能です。
- 独立した真空室に保管するため、個別に出し入れが可能です。
- TEM ホルダーポートはお客様のお使いの TEM ホルダーに合わせて製造いたします。



株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel 029-212-7600

Fax 029-212-7601

E-mail: [device@shinkuu.co.jp](mailto:device@shinkuu.co.jp)

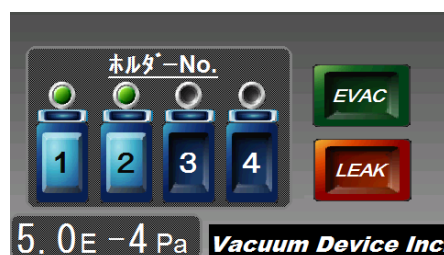
## 特 徴

### TEMホルダーについて

- TEMホルダーポートを4本搭載。
- お手持ちのホルダーに合わせたポートを作成します。
- TEMメーカー各社の特殊ホルダーに対応可能です。
- 独立排気系によりホルダー交換時、他の保管ホルダーは大気に晒されません。
- 各ホルダー試料部が見られるガラス窓付き(NW40フランジ)

### 操作性

- タッチパネル搭載で操作も簡単。
- プログラム制御による自動排気シーケンスやインターロック制御を搭載。
- ポンプのメンテナンス時期を画面に表示してお知らせいたします。



操作画面

## 仕 様

- 入力電源 : AC100V(単相100V)10A , アース線付3芯プラグ使用  
オプションのプラズマクリーナー付属時はAC100V(単相100V)15A
- 重量 : 30Kg
- 外観寸法 : W585mm X D555mm~ X H392mm  
(D寸法はTEMホルダーにより異なります)
- 到達真空度:  $5 \times 10^{-4}$  Pa以下
- 真空度測定: フルレンジ真空計
- ターボ分子ポンプ :  $80 \frac{\text{L}}{\text{sec}}$
- ダイヤフラムポンプ:  $20 \frac{\text{L}}{\text{sec}}$   
オプションのプラズマクリーナー付属時はスクロールポンプ付属
- 保管庫へのリーク用ガス導入ポート付き( $\phi 1 / 4$ インチ swagelok)  
(N2パージ使用時最大圧力:0.03MPa)
- 特別注文・改造につきましては、都度ご相談下さい。

## オプション

### ランプ加熱ユニット

- ・ 加熱方式:集光凹面鏡レンズ付ハロゲンランプによる加熱。
- ・ 放熱方式:ファンによる空冷放熱。
- ・ 温度制御:熱電対測温PID制御、電子タイマースイッチ付。
- ・ 制御電源サイズ:535 W x 550D x 185 H

### プラズマクリーニング ユニット

- ・ 電 源 : AC100V(単相 100V)3A, アース線付 3 芯プラグ使用
- ・ クリーニング対象:電子線照射により堆積したコンタミ除去及び付着防止。
- ・ ガス導入:ニードルバルブマニュアル調整、ガスパージ用電磁バルブ ON/OFF 方式
- ・ プラズマガス:空気、アルゴン、アルゴン/酸素、他対応
- ・ 安全対策:系統別ヒューズ採用
- ・ プラズマ電源 :周波数 13.56 MHz, 出力 0 ~50 W 可変、出力表示 デジタルメータ  
プラズマ点火表示ランプ付、プラズマ照射時間制御電子タイマー付  
タイマー :0~1,2, 3, 12, 30/sec, min, hr 各自由設定. 電子タイマー
- ・ プラズマ電源サイズ :250W X 300D X 135H 重量 9Kg
- ・ プラズマ銃サイズ :70mmΦ X 220L プラズマ銃取付 NW-40
- ・ガス :0.08~0.1 MPa, 配管 1/4" スウェジロック(ガスボンベ及び減圧弁はユーザ準備)

※ランプ加熱及びプラズマクリーニングユニットポートの使用はTEMホルダー形状により制限がございます。  
特に、異なるメーカーホルダーの共用はできません。

本カタログ記載内容は、改良に伴い予告なしに変更する場合があります。ご了承下さい。